

عنوان مقاله:

ضخامت سنجی لایه های نازک در حین فرآیند لایه نشانی و تعیین تابع دی الکتریک مختلط به صورت همزمان مبتنی بر زوایای تابش چندگانه بیم های لیزر

محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی خلاء (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

محمد رضا اشرفی - آزمایشگاه نانوالکترونیک ، دانشکده برق ، دانشگاه صنعتی شریف

علی کاشفیان

بیژن رشیدیان

خلاصه مقاله:

در این مقاله روشی جهت اندازه گیری تابع دی الکتریک مختلط و ضخامت فیلم های خیلی نازک به صورت همزمان، در طول پروسه لایه نشانی ارائه می شود. برای این منظور دستگاه معادلات شدت نور بازتابیده و عبوری تحلیل گردیده و اجزاء حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک و همچنین ضخامت فیلم در حال لایه نشانی بدست می آیند. نتایج عملی توسط یک سیستم طراحی شده برای دریافت بلادرنگ داده های شدت نور، برای لایه نشانی فلز آلومینیوم در دو طول موج لیزر برابر 650 نانومتر (نور قرمز روشن) و 780 نانومتر (نور مادون قرمز نزدیک) روی بستر شیشه ارائه شده اند.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/57251>

